

会 告

第4回学会賞，第5回真空の匠，第4回フェロー， 候補業績募集要項

一般社団法人日本真空学会

本賞は，真空科学技術，およびその関連分野等（例えば，表面・薄膜などの分野も含む）の進歩，ならびに，その産業利用の発展，あるいはそれらに関連する教育・学会活動への貢献に関し，この分野において成し遂げられた多大な功労や顕著な業績を規程により表彰するものです。

学会賞・真空の匠・フェロー候補に推薦され，また応募された業績に対して審査を行いますので，自薦他薦とも下記要領によりご応募下さい。

記

- 提出書類：A4判の書類（書式・頁数任意）に下記内容をご記載願います。
 - 推薦者名または応募者名（現（旧）所属と連絡先住所やメールアドレス等）
 - 推薦理由または応募理由（800字以内）
 - 業績リスト：特許や研究・技術発表，業績を示す関係事項，たとえば関連技術を利用した製品の販売数量等
特許の場合は，特許名と出願者および登録番号・登録年月日等。
論文・解説・技術資料等の場合は論文名・著者名・J. Vac. Soc. Jpn. 号・巻・頁等。
学会発表の場合は，講演会名・場所・年月日・タイトル・著者名等
- 提出先 一般社団法人日本真空学会事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館306号室
TEL：03-3431-4395，E-mail：ofc-vs@vacuum-jp.org
- 表彰対象者：日本真空学会正会員（法人会員として活動され，受賞時に正会員に登録された方を含む）
- 提出期限：平成29年4月1日（土）（厳守）

以上

一般社団法人日本真空学会 学会賞規程

（目的）

第1条 本表彰は，真空，表面および関連する科学・技術とその産業利用の進歩発展に関して顕著な功績をあげた一般社団法人日本真空学会（以下「本会」という）の正会員に対して日本真空学会学会賞を授与し，その功績を称えることを目的とする。

（推薦）

第2条 本会正会員および法人会員は別途定められた形式による推薦書によって学会賞の受賞候補者を推薦することができる。

（選定）

第3条 表彰審査会は，推薦された候補者の中から毎年2名以内の受賞にふさわしい候補者を選考して，理事会に推

薦する。理事会は表彰審査会から推薦された候補者について審議し，受賞者を決定する。

（表彰）

第4条 表彰は，真空に関する連合講演会において行い，受賞者には賞状を授与し，楯を贈呈する。

（受賞業績の公開）

第5条 受賞業績は，真空に関する連合講演会において紹介する。

（規程の改廃）

第6条 この規程は理事会の決議を経て変更することができる。

付則

この規程は平成26年1月30日から実施する。

一般社団法人日本真空学会 真空の匠 規程

（目的）

第1条 本表彰は，日本真空学会に関連した真空関連技術に長年専心し，あるいは，オリジナルな真空関連技術開発の先鞭をつけた一般社団法人日本真空学会（以下「本会」という）の正会員に対して日本真空学会真空の匠を授与し，その功績を称えることを目的とする。

（推薦）

第2条 本会正会員および法人会員は別途定められた形式による推薦書によって学会賞の受賞候補者を推薦することができる。

（選定）

第3条 顕彰審査会は，推薦された候補者の中から毎年若干

名の受賞にふさわしい候補者を選考して、理事会に推薦する。理事会は顕彰審査会から推薦された候補者について審議し、受賞者を決定する。

(表彰)

第4条 表彰は、真空に関する連合講演会において行い、受賞者には賞状を授与し、楯を贈呈する。

(受賞業績の公開)

第5条 受賞業績は、真空に関する連合講演会において紹介

する。

(規程の改廃)

第6条 この規程は理事会の決議を経て変更することができる。

付則

この規程は平成26年1月30日から実施する。

一般社団法人日本真空学会フェロー規程

(目的)

第1条 一般社団法人日本真空学会（以下「本会」という）は、本会における継続的な活動を通じて真空、表面および関連する科学・技術とその産業利用の進歩発展、あるいはそれらに関連する教育・公益活動に関して顕著な業績をあげた正会員に対し、日本真空学会フェロー（以下、「フェロー」という）の称号を授与し、その功績を称えとともに、本会を代表するにふさわしい会員としてのリーダーシップの発揮を奨励する。

(対象)

第2条 表彰の対象となる者は、原則として正会員もしくは法人会員に所属する個人として在籍した年数が10年以上の者であり、フェローの称号授与後、10年程度正会員として活動が可能なものとする。

(定員)

第3条 フェローの総数は全正会員の3%程度を上限とする。

(任期)

第4条 フェローの称号を授与された者は、本会正会員である期間その称号を名乗ることができる。ただし、名誉会員、功労会員あるいはシニア会員となる場合は称号を返上するものとする。

(役割)

第5条 フェローの称号を授与された者は、本会を代表する

会員としてリーダーシップを発揮し、本会活動一般に対して積極的に関わることを奨励する。

(候補者の推薦)

第6条 本会名誉会員、功労会員、シニア会員、在籍期間が累計10年以上の正会員および法人会員は別途定められた形式による推薦書によってフェロー候補者を推薦することができる。

(フェローの選出)

第7条 表彰審査会は、推薦された候補者の中からフェローにふさわしい候補者を選考して、理事会に推薦する。理事会は表彰審査会から推薦された候補者について審議し、フェローを決定する。

(表彰)

第8条 表彰は、真空に関する連合講演会において行い、受賞者には賞状を授与する。

(規程の改廃)

第9条 この規程は理事会の決議を経て変更することができる。

付則

この規程は平成26年1月30日から実施する。

過去の顕彰業績一覧

第1回 学会賞（平成26年度）

顕彰者名：辻 泰

顕彰者名：長村俊彦

顕彰業績名：「超高真空走査型プローブ顕微鏡およびナノプローブ表面電気特性測定装置開発への貢献」

第1回 真空の匠（平成20年度）

顕彰者名：遠藤元正

顕彰業績名：「放射光実験装置，宇宙科学実験装置の作製を通じた真空関連基礎研究への貢献」

第1回 フェロー（平成26年度）

顕彰者名：荒川一郎

顕彰者名：越川孝範

顕彰者名：笠岡玄一郎

顕彰業績名：「ターボ分子ポンプの国産化及び事業化」

顕彰者名：高橋 研

顕彰者名：賀集誠一郎

顕彰業績名：「真空ポンプ等真空部品の開発及び真空冶金装置の製造」

顕彰者名：平田正紘

顕彰者名：松田七美男

顕彰者名：北野盛丈

顕彰業績名：「極低温技術，超高真空技術を応用した研究開発機器・部品・装置の設計・製作」

第2回 学会賞（平成27年度）

顕彰者名：中山勝矢

顕彰者名：金原 粲

顕彰者名：齋藤尚武

顕彰業績名：「超高真空の実現と電子顕微鏡への応用」

第3回 真空の匠（平成27年度）

顕彰者名：渡辺文夫

顕彰業績名：「極高真空計，極高真空分圧計，極高真空材料，極高真空ポンプの開発」

顕彰者名：高橋重敏

顕彰業績名：「電子顕微鏡，電子回折装置などの高真空実験装置の設計・製作」

顕彰者名：北野 實

顕彰業績名：「超高真空技術と光学技術を高度に組み合わせた装置開発への貢献」

顕彰者名：高松源治

顕彰業績名：「原子衝突実験装置，表面科学研究装置，多価イオン実験装置，極高真空装置などの製作」

顕彰者名：亀井真悟

顕彰業績名：「超高真空装置開発と超高真空技術普及への貢献」

顕彰者名：沈 国華

顕彰業績名：「極高真空対応イオンポンプ，非円形金属シール，電子ビーム応用装置の開発」

第2回 フェロー（平成27年度）

顕彰者名：笠井秀明

顕彰者名：木村健二

顕彰者名：林 義孝

顕彰業績名：「超高真空技術及び成膜装置の開発」

顕彰者名：末次祐介

顕彰者名：北條久男

顕彰業績名：「水晶摩擦真空計の製品化」

顕彰者名：土佐正弘

顕彰者名：福谷克之

第2回 真空の匠（平成26年度）

顕彰者名：浦野 智秋

顕彰業績名：「完全磁気浮上型ターボ分子ポンプの開発」

第3回 学会賞（平成28年度）

顕彰者名：小林正典

顕彰者名：川下安司

顕彰業績名：「イオンプレーティング成膜装置の開発」

顕彰者名：小野雅敏

第3回 フェロー（平成28年度）

顕彰者名：荻原徳男

顕彰者名：間瀬一彦

顕彰者名：秋道 斉